

***Judul:***

Pembuatan Lapisan Pelindung ZrN dengan Metoda Sputtering Reaktif

***Pengarang/Penulis:***

Rachmat Widodo Adi, author

***Subjek:***

Film coefficients (Physics)

***Nomor Panggil:***

LP-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)